

PLV1000

piezoelectric gas doser

UHV 環境下の極微量ガス導入調整器

PLV1000 piezoelectric gas doserは、UHVの装置に適合したオールメタルのリークバルブで、内蔵された圧電素子を用いて制御します。

電圧の印加によって内部の圧電素子に歪みが生じ、この現象を利用して内部で強力なスプリングによりシートに押付けられているセラミックスプランジャーを引き上げ、流量をコントロールします。

ノーマルクローズの設計になっており、小型の電源からパワーが供給されます。また、バルブの取付場所が手の届かない場所や危険な場所であっても遠隔操作が出来るようになっています。

電圧による圧電スタックの線形拡張は、リーク率とノブを使って手動でコントロールするバルブを使用した場合と類似しています。極微量なガス流量での制御が必要な場合に最適です。

特殊仕様でオゾンガス対応も出来ます。

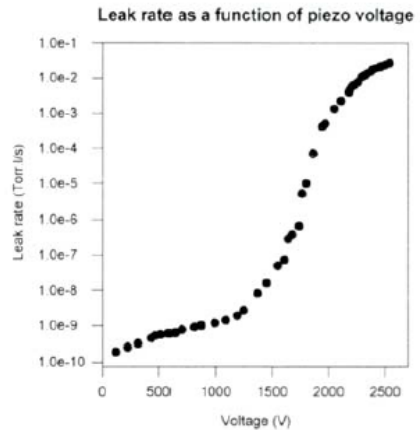


<仕様>

- | | |
|-----------------|--|
| ◆ 取付 | NW16CF/VCR(入口のみ) |
| ◆ オペレーション電圧 | 0-1000V |
| ◆ リークレート | $5 \times 10^{-10} \sim 5 \times 10^{-2}$ torr.l.s ⁻¹ |
| ◆ 最小パルスデューレーション | 20 msec |
| | 5VDCまたはTTL |
| ◆ 動作温度 | 室温 |
| ◆ 停電時 | クローズ(ノーマルクローズ) |

<オプション>

- ◆ シリアル通信PCインターフェース



右のグラフは3kV 旧モデルのものですが、現行の1kVでも同様です
* 外観、仕様は予告なく変更されることがあります